## Динамика излучения Yb, Er-лазера с диодной накачкой при воздействии на пассивный затвор мощной внешней подсветки

Е.О.Батура, Ю.К.Бобрецова, М.В.Богданович, Д.А.Веселов, А.В.Григорьев, В.Н.Дудиков, А.М.Кот, Н.А.Пихтин, А.Г.Рябцев, Г.И.Рябцев, С.О.Слипченко, П.В.Шпак

Исследована временная динамика Yb, Er-лазера с поперечной диодной накачкой при воздействии на пассивный  $Co^{2+}:MgAl_2O_4$ -затвор излучения полупроводникового импульсного модуля с интегральной плотностью потока энергии  $0.15-0.16 \ Джc/cm^2$ . Показано, что с помощью внешней подсветки затвора можно изменять время задержки начала генерации и величину временного джиттера  $\Delta T_{gi}$ . Зависимость  $\Delta T_{gi}$  от интервала между моментом включения модуля подсветки и моментом тенерации лазерного пика  $t_i$  имеет минимум при  $|t_i| \approx 10$  мкс. Уменьшение  $\Delta T_{gi}$  при изменении  $|t_i|$  от 90 до 10 мкс свидетельствует о том, что момент появления пика генерации Yb, Er-лазера частично контролириется импульсом излучения высокостабильного полупроводникового модуля. Если же  $|t_i| < 10$  мкс, то плотность потока энергии усиленной люминесценции в резонаторе Yb, Er-лазера становится более 0.16 Джc/cm<sup>2</sup>, излучение модуля подсветки уже не оказывает заметного влияния на процесс генерации иттербий-эрбиевого лазера и, как следствие, величина временного джитера возрастает до исходного значения.

**Ключевые слова:** твердотельный лазер, диодная накачка, полупроводниковый лазерный модуль, пассивная модуляция добротности, джиттер импульсов.

### 1. Введение

Импульсные эрбиевые лазеры с диодной накачкой, генерирующие в условно безопасном для органов зрения спектральном диапазоне 1.53-1.54 мкм, – перспективные источники излучения для приборов дальнометрии и спектроскопии [1–5]. Среди излучателей данного типа большое распространение получили компактные лазеры на основе Yb, Er-стекла, возбуждаемые по схеме поперечной накачки [2, 4, 6]. С целью минимизации габаритов режим модуляции добротности лазера задается, как правило, с помощью пассивных просветляющихся затворов [1, 2, 4], например на основе кристаллов LiGa<sub>5</sub>O<sub>8</sub>, LaMgAl<sub>11</sub>O<sub>19</sub> или MgAl<sub>2</sub>O<sub>4</sub> [7].

Одним из недостатков, характерных для твердотельных лазеров с пассивной модуляцией добротности, является значительная временная нестабильность момента начала импульса генерации – временной джиттер [8], связанный с вариациями интенсивности, пространственных и/или спектральных параметров излучения накачки, с воздействием на активную среду спонтанного шума, а также с процессами межмодового взаимодействия. Как показано в [9–12], временной джиттер лазера может быть существенно уменьшен путем модулирования мощности излучения накачки прямоугольными импульсами, применени-

Поступила в редакцию 10 февраля 2020 г.

ем двух синхронизованных лазерных каналов и внешней подсветкой пассивного затвора. Представленные в литературе результаты исследований в данном направлении относятся к твердотельным лазерам на основе Nd: YAG или рубина с пассивными затворами на основе кристаллов  $Cr^{4+}$ : YAG,  $F_2^-$ : LiF или раствора красителя.

Целью настоящей работы является исследование временной динамики Yb, Er-лазера с поперечной диодной накачкой в условиях, когда на пассивный затвор воздействует сфокусированное излучение мощной внешней подсветки. В качестве пассивного затвора использовался кристалл  $\mathrm{Co}^{2+}$ : MgAl<sub>2</sub>O<sub>4</sub>, широко применямый в современных портативных эрбиевых лазерах. Излучение для подсветки пассивного затвора формировалось с помощью импульсного модуля на базе полупроводниковых лазеров со сверхузким волноводом, интегрированных с платой токовой накачки.

# 2. Экспериментальная установка и методика измерений

Схема установки для исследования временной динамики Yb, Er-лазера с поперечной диодной накачкой и подсветкой пассивного затвора представлена на рис.1. Накачка активного элемента (AЭ) проводилась по поперечной схеме блоком линеек лазерных диодов (ЛЛД) МДН-70-940 (НПП «Инжект», Саратов). Возбуждение ЛЛД осуществлялось импульсами тока длительностью 4–5 мс при частоте следования импульсов 2 Гц. Материалом для AЭ прямоугольного поперечного сечения (1.5 × 2.0 × 35 мм) служило Yb, Er-фосфатное стекло марки ЛГС-ДЕ (Фрязинский филиал ИРЭ РАН, Фрязино, MO). Концентрации ионов иттербия и эрбия составляли  $1.8 × 10^{21}$  и  $3.0 × 10^{19}$  см<sup>-3</sup> соответственно. Резонатор лазера формировался плоскими зеркалами 2 и 3. Режим моду-

**Е.О.Батура, М.В.Богданович, А.В.Григорьев, В.Н.Дудиков, А.М.Кот, А.Г.Рябцев, Г.И.Рябцев, П.В.Шпак.** Институт физики им. Б.И.Степанова НАНБ, Республика Беларусь, 220072 Минск, просп. Независимости, 68

Ю.К.Бобрецова, Д.А.Веселов, Н.А.Пихтин, С.О.Слипченко. Физикоко-технический институт им. А.Ф.Иоффе РАН, Россия, 194021 С.-Петербург, Политехническая ул., 26; e-mail: bobre-yulya@yandex.ru



Рис.1. Оптическая схема установки для исследования временной динамики Yb, Er-лазера с поперечной диодной накачкой в условиях подсветки пассивного затвора:

I – корпус лазера; 2 – выходное плоское полупрозрачное зеркало; 3 – плоское глухое зеркало; 4 – блок накачки ЛЛД; 5 – ЛЛД; 6 – АЭ из фосфатного Yb, Er-стекла; 7 – излучение блока ЛЛД (940–950 нм); 8, 9, 10 – быстродействующие фотодиоды; 11 – генератор синхроимпульсов; 12 – цифровой многоканальный осциллограф; 13 – измеритель энергии лазерных импульсов; 14 – пассивный затвор (кристалл Co<sup>2+</sup>: MgAl<sub>2</sub>O<sub>4</sub>); 15 – импульсный модуль подсветки; 16 – фокусирующая оптика. На вставке – вид импульса излучения блока накачки (940–950 нм), регистрируемого фотодиодом 8; буквами G и E обозначены импульсы генерации Yb, Er-лазера (1534 нм) и блока внешней подсветки соответственно, точка A – начало отсчетов временных интервалов.

лированной добротности обеспечивался просветляющимся Co<sup>2+</sup>: MgAl<sub>2</sub>O<sub>4</sub>-затвором с величиной начального пропускания 75%. При комнатной температуре рабочее значение энергии импульсов излучения на выходе исследуемого Yb, Er-лазера составляло 10 мДж, длина волны равнялась 1.54 мкм, а длительность импульсов – 16 нс. Внешняя подсветка Co<sup>2+</sup>: MgAl<sub>2</sub>O<sub>4</sub>-затвора осуществлялась импульсным модулем 15 на базе лазерных диодов со сверхузким волноводом [13]. Импульсы излучения модуля длительностью 900 нс и энергией 13 мкДж фокусировались оптической системой 16 на поверхности пассивного затвора в виде круглого пятна диаметром менее 100 мкм в окрестности центра лазерной моды диаметром ~700 мкм. Диаметр сфокусированного пятна измерялся по уровню 0.5 максимальной интенсивности с помощью высокоразрешающей камеры, погрешность измерений не превышала 10%. Длина волны излучения импульсного модуля варьировалась в пределах 1.54-1.57 мкм в зависимости от температуры ЛЛД модуля и уровня возбуждения. Данный интервал длин волн попадает в широкий максимум спектральной зависимости коэффициента поглощения кристалла Co<sup>2+</sup>: MgAl<sub>2</sub>O<sub>4</sub>, определяемой оптическим переходом  ${}^{4}A_{2} \rightarrow {}^{4}T_{1}({}^{4}F)$  (рис.2).

Временная динамика Yb, Er-лазера в условиях подсветки пассивного затвора исследовалась следующим образом. Импульсами излучения накачки (см. вставку на рис.1) возбуждался AЭ, и одновременно с помощью фотодиода 8 в момент времени  $T_0$  запускался генератор синхроимпульсов 11. Поскольку момент просветления пассивного затвора 14 с последующим развитием процесса генерации не задается какими-либо вспомогательными



Рис.2. Спектр поглощения (*a*) и схема энергетических уровней ( $\delta$ ) пассивного затвора на основе кристалла Co<sup>2+</sup>: MgAl<sub>2</sub>O<sub>4</sub> в ближней ИК области спектра [7, 14–17].

элементами, то за начало отсчета временных интервалов  $T_0$  с помощью специализированной программы выбиралась точка А на линейном участке переднего фронта импульса излучения накачки (см. вставку на рис.1). Стабилизация температуры Yb, Ег-лазера и электрических параметров блока накачки 4 позволили добиться высокой повторяемости формы импульса и погрешности задания положения точки А на уровне ± 50 нс.

Импульсы синхронизации генератора 11 использовались для запуска развертки многоканального осциллографа 12 и импульсного модуля подсветки 15, при этом запуск модуля подсветки относительно начала возбуждения активного элемента  $T_0$  программируемым методом задерживался на время  $T_{\rm ei}$ . Момент генерации лазерного импульса устанавливался по интенсивному пику излучения (обозначен буквой G на вставке к рис.1), рассеиваемого на поверхности измерителя энергии 13 в направлении фотодиода 10.

На начальной стадии экспериментов для серии из нескольких десятков тысяч импульсов Yb, Er-лазера измерялось среднее значение времени появления пика генерации  $\bar{T}_{g0}$ . Величина временного джиттера Yb, Er-лазера для исследуемой серии  $\Delta T_{g0}$  определялась как среднеквадратичное отклонение времени появления пика генерации от значения  $\bar{T}_{g0}$  (рис.3, точка P). Спустя время  $T_{ei} < \bar{T}_{g0}$ включался импульсный модуль подсветки, и для выбранной конфигурации эксперимента также регистрировались среднее время появления пика генерации  $\bar{T}_{gi}$  и величина



Рис.3. Зависимости интервала  $T_{\rm dif}$  между средними значениями  $\hat{T}_{g0}$  и  $\hat{T}_{gi}$  (1) и временного джиттера  $\Delta T_{gi}$  (2) от параметра  $t_i$ ; точкой Р обозначено исходное значение временного джиттера.

временного джиттера  $\Delta T_{\rm gi}$ . Значения  $T_{\rm ei}$  выбирались таким образом, чтобы абсолютная величина разности  $t_{\rm i} = T_{\rm ei} - \bar{T}_{\rm g0}$ , которая определяет временной интервал между моментом включения модуля подсветки и моментом появления лазерного пика  $\bar{T}_{\rm g0}$ , находилась в пределах 9–90 мкс.

Зависимость разности средних значений времени начала генерации без подсветки и с подсветкой пассивного затвора излучением внешнего импульсного модуля  $T_{\rm dif} = \bar{T}_{\rm g0} - \bar{T}_{\rm gi}$  от переменного параметра  $t_{\rm i}$  показана на рис.3. Там же представлена величина временного джиттера  $\Delta T_{\rm gi}$  исследованного Yb, Er-лазера как функция переменной  $t_{\rm i}$  в условиях внешней подсветки пассивного затвора.

### 3. Результаты и их обсуждение

Использованный в настоящей работе полупроводниковый импульсный модуль [13] излучает в диапазоне длин волн 1.54–1.57 мкм, который полностью попадает в широкую полосу ИК поглощения кристалла  $Co^{2+}:MgAl_2O_4$ . Канал поглощения в данном спектральном интервале задается главным образом параметрами перехода иона  $Co^{2+}$ из основного (нижнего) состояния  ${}^{4}A_2$  на верхний широкий уровень  ${}^{4}T_1({}^{4}F)$  с последующим быстрым переходом на уровень  ${}^{4}T_2({}^{4}F)$  [7]. Отношение сечений поглощения для переходов  ${}^{4}A_2 \rightarrow {}^{4}T_1({}^{4}F)$  и  ${}^{4}T_2({}^{4}F) \rightarrow {}^{4}T_1({}^{4}P)$  на длине волны 1.54 мкм равно 0.03. Времена жизни для уровней  ${}^{4}T_1({}^{4}F)$  и  ${}^{4}T_2({}^{4}F)$  составляют 15 пс и 350 нс соответственно.

Приближенно, без учета поглощения из возбужденного состояния  ${}^{4}T_{2}({}^{4}F)$ , процесс просветления исследуемого пассивного затвора эрбиевого лазера можно представить в рамках подхода, включающего в рассмотрение основной (нижний) уровень  ${}^{4}A_{2}$  и верхний широкий уровень как комбинацию уровней  ${}^{4}T_{1}({}^{4}F)$  и  ${}^{4}T_{2}({}^{4}F)$ . Согласно расчетным и экспериментальным данным [7, 18], коэффициент поглощения такой «квазидвухуровневой» системы, приведенный к начальному значению, падает на 15%-20% уже при уровнях интегральной плотности потока энергии излучения S = 0.15-0.20 Дж/см<sup>2</sup>.

Значение *S* для импульсного модуля подсветки составляет примерно 0.15–0.16 Дж/см<sup>2</sup>, поэтому можно предположить, что оптические потери эрбиевого лазера в той или иной степени уменьшаются под действием падающего на  $Co^{2+}$ : MgAl<sub>2</sub>O<sub>4</sub>-затвор внешнего излучения. По этой причине пик генерации лазера появляется в момент  $\bar{T}_{gi} < \bar{T}_{g0}$ . По мере смещения  $|t_i|$  к нулю оптические переходы, свя-

занные с просветлением затвора излучением импульсного модуля, играют все более заметную роль в процессе развития генерации Yb, Er-лазера. Кривая *I* на рис.3 быстро возрастает, когда абсолютная величина  $t_i$  приближается к 20–30 мкс. Как свидетельствуют результаты численных расчетов характеристик исследованного Yb, Er-лазера, выполненные для модели, которая учитывает пространственные свойства резонатора, при  $|t_i| < 20$  мкс коэффициент усиления по порядку величины сравнивается с оптическими потерями и формируется поток усиленной люминесценции. Это приводит к доминированию эффекта просветления пассивного затвора в процессах генерации лазерного пучка.

Как следует из совместного анализа кривых l и 2 рис.3, воздействие излучения импульсного модуля сказывается не только на времени задержки начала генерации – значение  $T_{dif}$  возрастает по мере приближения  $t_i$  к нулю, но и на величине временного джиттера  $\Delta T_{gi}$ . Зависимость  $\Delta T_{gi}$  от  $t_i$  имеет хорошо выраженный минимум при  $|t_i| \approx 10$  мкс. Уменьшение временного джиттера при изменении от 90 до 10 мкс является следствием того, что в данной области значений  $t_i$  момент появления пика генерации Yb, Ег-лазера частично контролируется импульсом излучения высокостабильного полупроводникового модуля.

Временной джиттер импульсного модуля подсветки не превышал 10 нс, поэтому относительно высокое значение временного джиттера Yb, Er-лазера в минимуме зависимости  $\Delta T_{\rm gi}(t_i)$ , равное 1854 нс, вероятнее всего, объясняется нестабильностью процессов возбуждения его активной среды. Когда  $|t_i| < 10$  мкс, интенсивность потока усиленной люминесценции в резонаторе Yb, Er-лазера резко возрастает, приближаясь, согласно данным численных расчетов, к 15–20 Дж/см<sup>2</sup> при  $|t_i| < 0.5$  мкс. В этих условиях излучение импульсного модуля подсветки не оказывает существенного влияния на процесс генерации Yb, Er-лазера, и величина временного джиттера возрастает до исходного значения (точка P на рис.3).

Следует отметить, что при плотностях потока энергии подсветки свыше  $0.15 \text{ Дж/см}^2$ , но меньших длительностях импульсов (например, при уменьшении длительности импульса до 100 нс) воздействия излучения импульсного модуля на характеристики Yb, Er-лазера не наблюдалось при всех значениях  $t_i$  в пределах 9–90 мкс. Возможно, это связано с тем, что время развития лазерного импульса в данном случае (3–5 мкс) значительно превышает время воздействия излучения импульсного модуля.

#### 4. Заключение

Временная динамика Yb, Er-лазера с поперечной диодной накачкой исследована в условиях воздействия на пассивный затвор сфокусированного излучения блока мощной внешней подсветки. В качестве пассивного затвора применен кристалл Co<sup>2+</sup>: MgAl<sub>2</sub>O<sub>4</sub>. Установлено, что воздействие на затвор излучения импульсного модуля с интегральной плотностью потока энергии 0.15–0.16 Дж/см<sup>2</sup> сказывается на времени задержки начала генерации Yb, Er-лазера и на величине его временного джиттера  $\Delta T_{gi}$ , зависимость которого от временного интервала между моментом включения модуля подсветки и моментом генерации лазерного пика имеет минимум при  $|t_i| \approx 10$  мкс. Уменьшение временного джиттера при изменении  $|t_i|$  от 90 до 10 мкс является следствием того, что в данной области значений  $t_i$  момент появления пика генерации Yb, Erлазера частично контролируется импульсом излучения высокостабильного полупроводникового модуля. Относительно высокое значение временного джиттера Yb, Er-лазера (1854 нс), регистрируемое в минимуме зависимости  $\Delta T_{gi}(t_i)$ , объясняется нестабильностью процессов возбуждения его активной среды. Когда  $|t_i| < 10$  мкс, плотность потока энергии усиленной люминесценции в резонаторе Yb, Er-лазера возрастает до 15–20 Дж/см<sup>2</sup>, излучение импульсного модуля подсветки не оказывает существенного влияния на процесс генерации Yb, Er-лазера, и величина временного джиттера вновь достигает исходного значения 1970 нс.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 18-52-00022) и БРФФИ (проект Ф18Р-145).

- 1. Шачкин Л.В. Квантовая электроника, **36**, 106 (2006) [Quantum Electron., **36**, 106 (2006)].
- Bogdanovich M.V., Kabanov V.V., Ryabtsev G.I., Ryabtsev A.G., Lebiadok Y.V. Proc. SPIE, 8677, 86770X-1 (2013).
- 3. Старовойтов Е.И., Савчук Д.В., Зубов Н.Е. *Наука и образование:* научное издание МГТУ им. Н.Э. Баумана, № 8, 215 (2013).
- Богданович М., Григорьев А., Ланцов К., Лепченков К., Рябцев А., Рябцев Г., Титовец В., Щемелев М. Фотоника, 55, 58 (2016).
- 5. Бондаренко Д.А., Карасик В.Е., Магдич Л.Н., Погонышев О.О., Садовский П.И., Семенков В.П. Вестник МГТУ им. Н.Э. Баумана. Сер. Приборостроение, № 5, 14 (2017).

- Шачкин Л.В. Квантовая электроника, 37, 130 (2007) [Quantum Electron., 37, 130 (2007)].
- Yumashev K.V., Denisov I.A., Posnov N.N., Kuleshov N.V., Moncorege R. J. Alloys Compd., 341, 366 (2002).
- 8. Paschotta R. Appl. Phys. B, 79, 163 (2004).
- 9. Muller A., Willenbring G.R. Appl. Phys., 4, 47 (1974).
- Dascalu T., Pavel N., Pupei V., Philipps G., Weber H. Opt. Eng., 35, 1247 (1996).
- Cole B., Goldberg L., Trussell C.W., Hays A., Schilling B.W., McIntosh Ch. Opt. Express, 17, 1766 (2009).
- Дементьев А.С., Мураускас Э., Славинскис Н., Навакас Р., Сточкус В. Квантовая электроника, 42, 437 (2012) [Quantum Electron., 42, 437 (2012)].
- Бобрецова Ю.К., Веселов Д.А., Воронкова Н.В., Слипченко С.О., Стрелец В.А., Богданович М.В., Шпак П.В., Ладугин М.А., Мармалюк А.А., Пихтин Н.А. Квантовая электроника, 49, 488 (2019) [Quantum Electron., 49, 488 (2019)].
- 14. Hercher M. Appl. Opt., 6, 947 (1967).
- Shcherbitsky V.G., Girard S., Fromager M., Moncorge R., Kuleshov N.V., Levchenko V.I., Yakimovich V.N., Ferrand B. *Appl. Phys. B.*, 74, 367 (2002).
- Кисель В.Э., Щербицкий В.Г., Кулешов Н.В., Постнова Л.И., Левченко В.И., Галаган Б.И., Денкер Б.И., Сверчков С.Е. *Квантовая электроника*, **35**, 611 (2005) [*Quantum Electron.*, **35**, 611 (2005)].
- Demesh M., Marzahl D.-T., Yasukevich A., Kisel V., Huber G., Kuleshov N., Krankel Ch. *Opt. Lett.*, **42**, 4687 (2017).
- Грибковский В.П. Теория поглощения и испускания света в полупроводниках (Минск: Наука и техника. 1975).